# 各種 DLC 膜表面に対する酸素プラズマ処理効果の検討

Effect of Oxygen Plasma Treatment for Different Types of DLC film 東京電機大学 <sup>1</sup>, ナノテック (株) <sup>2</sup> <sup>○</sup>(M2)河内 佑太 <sup>1</sup>, 平塚 傑工 <sup>2</sup>, 坪井 仁美 <sup>2</sup>, 中森 秀樹 <sup>2</sup>, 本間 章彦 <sup>1</sup>, 平栗 健二 <sup>1</sup>, 大越 康晴 <sup>1</sup>

Tokyo Denki Univ. <sup>1</sup>, Nanotech Corp. <sup>2</sup>, <sup>°</sup>Yuta Kawachi<sup>1</sup>, Masanori Hiratsuka<sup>2</sup>, Hitomi Tsuboi<sup>2</sup>, Hideki Nakamori<sup>2</sup>, Akihiko Homma, Kenji Hirakuri<sup>1</sup>, Yasuharu Ohgoe<sup>1</sup>

### E-mail: yasuharu@mail.dendai.ac.jp

## 1. 研究背景

ダイヤモンドライクカーボン (DLC) を含む水素化アモルファス炭素 (a-C:H) 膜は,各種手法の最適化によって,従来の優れた機械的特性の他に,良好な抗血栓性や細胞親和性などの生体適合性が報告されている<sup>(1,2)</sup>. 先行研究では,DLC表面に形成される C=O 結合の割合と細胞接着性に,強い相関性が報告されている<sup>(3)</sup>. また,細胞接着性の促進を目的とした表面処理として,酸素プラズマ処理がよく知られている。そこで本研究では,任意に作製した DLC表面に対し,反応性の強い酸素プラズマ処理を一律に施し,表面状態の経時的な変化について評価した.

#### 2. 実験方法

イオン化蒸着法,DC パルス CVD 法,高周波プラズマ CVD 法,マグネトロンスパッタリング (HiPIMS) 法によって,それぞれ Si (100)基板に成膜した.そして,これらの DLC 表面に対し,一律に,高周波放電を用いた酸素プラズマ処理を行った.酸素処理による DLC の表面状態の経時変化については,XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy)分析にて間接的に評価した.

#### 3. 実験結果および考察

各種 DLC の表面に対し,酸素プラズマ処理を施した表面状態(XPS スペクトル)を図1に示す.

酸素処理開始直後では、各種 DLC について、いずれも表面部の領域がエッチングされると同時に、C=O 結合の増加が見られた。その後、エッチングが膜中間部まで進行する際は、DLC 表面の C=O 結合の増減は比較的一定となった。更にエッチングが進行し、基板界面まで到達する際は、C=O 結合は減少する様子が確認された。これは、各種成膜手法に関わらず、DLC の表面部、

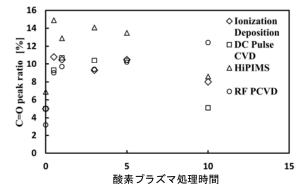


図1 DLC表面のC=O結合と酸素プラズマ処理時間

中間部,界面部において膜の組成が一様ではないため,各エッチング領域(深さ方向)において酸素プラズマ処理の効果が異なったと考えられる.

## 参考文献

- 1. 斎藤秀俊 監修, DLC 膜ハンドブック, 株式会社エヌ・ティー・エス, pp224-231, 2006.
- 2. 平塚傑工, DLC コーティング技術と今後の動向,素形材, vol.50, No.8, pp8-13, 2009.
- 3. M. Hibino *et al.*, New Diamond Nano Carbons Conference 2012, New Diamond and Nano Carbons Conference 2012, p23, 2012.